

## 液体ガス化装置付きスライド Pecvd 管状炉 Pecvd 装置

商品番号: KT-PE12



前書き

KT-PE12 スライド PECVD システム:  
 広い出力範囲、プログラム可能な温度制御、スライド  
 システムによる高速加熱/冷却、MFC  
 質量流量制御および真空ポンプ。

[詳細を学ぶ](#)

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 炉モデル       | KT-PE12-60                        |
| 最大。温度      | 1200°C                            |
| 一定の作業温度    | 1100°C                            |
| 炉管材質       | 高純度クォーツ                           |
| 炉管径        | 60mm                              |
| 加熱ゾーンの長さ   | 1×450mm                           |
| チャンバー材質    | 日本製アルミナファイバー                      |
| 発熱体        | Cr2Al2Mo2線コイル                     |
| 加熱速度       | 0~20°C/分                          |
| 熱電対        | ビルドインKタイプ                         |
| 温度調節器      | デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー |
| 温度制御精度     | ±1°C                              |
| 摺動距離       | 600mm                             |
| RFプラズマユニット |                                   |
| 出力電力       | 5-500W ± 1% の安定性で調整可能             |
| RF周波数      | 13.56MHz ± 0.005% の安定性            |
| 反射力        | 最大350W                            |
| マッチング      | 自動                                |
| ノイズ        |                                   |
| 冷却         | 空冷。                               |
| ガス精密制御ユニット |                                   |
| 流量計        | MFC質量流量計                          |
| ガスチャネル     | 4チャンネル                            |

流量  
 MFC1: 0-5SCCM O2  
 MFC2: 0-20SCCMCH4  
 MFC3: 0-100SCCM H2  
 MFC4: 0-500 SCCM N2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 直線性              | ±0.5%FS                       |
| 再現性              | ±0.2%FS                       |
| パイプラインとバルブ       | ステンレス鋼                        |
| 最高使用圧力           | 0.45MPa                       |
| 流量計コントローラ        | デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー |
| 標準真空ユニット (オプション) |                               |
| 真空ポンプ            | ロータリーベーン真空ポンプ                 |
| ポンプ流量            | 4L/S                          |
| 真空吸引ポート          | KF25                          |
| 真空計              | ピラニ/抵抗シリコン真空計                 |
| 定格真空圧力           | 10Pa                          |
| 高真空ユニット (オプション)  |                               |
| 真空ポンプ            | ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ             |
| ポンプ流量            | 4L/S+110L/S                   |
| 真空吸引ポート          | KF25                          |
| 真空計              | 複合真空計                         |
| 定格真空圧力           | 6×10 <sup>-5</sup> Pa         |

上記の仕様および設定はカスタマイズ可能です

| いいえ。 | 説明              | 量 |
|------|-----------------|---|
| 1    | 炉               | 1 |
| 2    | 石英管             | 1 |
| 3    | 真空フランジ          | 2 |
| 4    | チューブサーマルブロック    | 2 |
| 5    | チューブサーマルブロックフック | 1 |
| 6    | 耐熱手袋            | 1 |
| 7    | RFプラズマ源         | 1 |
| 8    | 正確なガス制御         | 1 |
| 9    | バキュームユニット       | 1 |
| 10   | 取扱説明書           | 1 |